(19)日本国特許庁 (JP) (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2002-337262 (P2002-337262A)

(43)公開日 平成14年11月27日(2002.11.27)

(51) Int.Cl.7		識別記号	FΙ		テ	-マコード(参考)
B 3 2 B	9/00		B 3 2 B	9/00	Α	4 F 1 0 0
C 2 3 C	14/08		C 2 3 C	14/08	Α	4 K 0 2 9
	14/20			14/20	Α	

審査請求 未請求 請求項の数7 OL (全 6 頁)

(21)出願番号	特願2001-152045(P2001-152045)	(71)
(21)出願番号	符膜2001-152045(P2001-152045)	(7

(22)出願日 平成13年5月22日(2001.5.22) 1)出願人 000003193

凸版印刷株式会社

東京都台東区台東1丁目5番1号

(72) 発明者 鈴木 浩

東京都台東区台東1丁目5番1号 凸版印

刷株式会社内

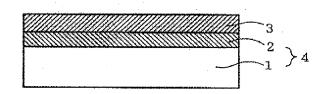
最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 高ガスバリア性フイルム及びその製造方法

(57)【要約】

【課題】基材フイルムの表面に蒸着薄膜層を形成させる 時に、フイルム表面から蒸着薄膜の膜厚の外側に向けて 傾斜型の金属酸化物組成の蒸着薄膜層を、容易に、か つ、安定して形成させることにより、高いガスバリア性 を有するフイルムを提供するものである。

【解決手段】高分子材料からなる基材フイルム1の少な くとも一方の面に、酸化アルミニウムの蒸着薄膜層2、 ガスバリア性被膜層3を順次積層した積層体において、 該酸化アルミニウムの蒸着薄膜が金属蒸気と酸化性ガス との反応性蒸着法で形成されたものからなることを特徴 とする。



10

1

【特許請求の範囲】

【請求項1】高分子材料からなる基材フイルムの少なくとも一方の面に、酸化アルミニウムの蒸着薄膜層、ガスバリア性被膜層を順次積層した積層体において、該酸化アルミニウムの蒸着薄膜が金属蒸気と酸化性ガスとの反応性蒸着法で形成されたものからなることを特徴とする高ガスバリア性フイルム。

【請求項2】前記金属蒸気がアルミニウム蒸気であり、かつ、酸化性ガスが酸素ガスであることを特徴とする請求項1記載の高ガスバリア性フイルム。

【請求項3】前記蒸着薄膜層の厚さが50~3000Åの範囲内であることを特徴とする請求項1又は請求項2 記載の高ガスバリア性フイルム。

【請求項4】前記ガスバリア性被膜層が、水溶性高分子と、(a)1種以上の金属アルコキシド及びその加水分解物又は(b)塩化錫の少なくとも一方を含むものからなることを特徴とする請求項1乃至請求項3のいずれか1項記載の高ガスバリア性フイルム。

【請求項5】前記水溶性高分子が、ポリビニルアルコールであることを特徴とする請求項4記載の高ガスバリア 20性フイルム。

【請求項6】前記金属アルコキシドが、テトラエトキシシランまたはトリイソプロポキシアルミニウムあるいはそれらの混合物であることを特徴とする請求項4又は請求項5記載の高ガスバリア性フイルム。

【請求項7】前記請求項1乃至請求項6のいずれか1項記載の高ガスバリア性フイルムの酸化アルミニウムの蒸着薄膜層を金属蒸気と酸化性ガスの反応性蒸着法で形成する時に、前記酸化性ガスを真空蒸着装置内の冷却ドラムの基材巻き出し側の表面より10mm以上150mm 30以下の位置の供給口から導入することを特徴とする高ガスバリア性フイルムの製造方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、食品、医薬品、精 密電子部品等の包装分野に用いられる透明なガスバリア 材に関するものである。

[0002]

【従来の技術】近年、食品、医薬品、精密電子部品等の包装に用いられる包装材料は、内容物の変質、とくに食 40品においては蛋白質や油脂等の酸化、変質を抑制し、さらに味や鮮度を保持するために、またクリーン状態での取扱いが必要とされる医薬品においては有効成分の変質を抑制し、効能を維持するために、さらに精密電子部品においては金属部分の腐食、絶縁不良等を防止するために、包装材料を透過する酸素、水蒸気、その他内容物を変質させる気体による影響を防止する必要があり、これら気体(ガス)を遮断するガスバリア性を備えることが求められている。

【0003】そのため、従来から塩化ビニリデン樹脂を 50 の真空チャンバー11内の冷却ドラム15の中央の下端

コートしたポリプロピレン(KOP)や塩化ビニリデン 樹脂をコートしたポリエチレンテレフタレート(KPE T)あるいはエチレン・ビニルアルコール共重合体(E VOH)など一般にガスバリア性が比較的高いと言われ る高分子樹脂組成物をガスバリア材として包装材料に用 いた包装フイルムやアルミニウム(以下、A1とする) などの金属からなる金属箔、高分子樹脂フイルムにA1 などの金属又は金属化合物を蒸着した金属蒸着フイルム を用いた包装材料が一般的に使用されてきた。

【0004】ところが、上述の高分子樹脂組成物をガス バリア材として用いた包装材料は、A1などの金属又は 金属化合物を用いた箔やこれらの蒸着層を形成した金属 蒸着フイルムに比べると温度・湿度の影響を受けてガス バリア性が劣化する傾向がある。一方、A1などの金属 又は金属化合物を用いた箔やこれらの蒸着層を形成した 金属蒸着フイルムは、温度・湿度などの影響を受けるこ とは少なく、ガスバリア性に優れるが、包装体の内容物 を透視して確認することができない等の欠点を有してい た。

1 【0005】そこで、これらの欠点を克服した包装用材料として、最近ではセラミック薄膜を透明な高分子材料からなる基材上に蒸着法などの形成手段により形成された蒸着フイルムが上市されている。

【0006】前記セラミック薄膜の材料としては、酸化アルミニウム(A10x)、一酸化珪素(SiO)などの珪素酸化物、酸化マグネシウム、酸化カルシウムなどが安全性、原材料価格の点などで候補となりうる。しかしながら珪素酸化物は材料特有の色があるため、高透明にはなり得ず、また酸化マグネシウム、酸化カルシウムは原材料の昇華温度が高く、そのために蒸着工程における蒸発速度が遅くなる。そのためガスバリア性を発現させるのに十分な200 Å程度の膜厚の薄膜を付着させようとすると、製膜時間が長時間になり、高コストに繋がるため商業的採算が合わないなどの欠点があった。

【0007】上記理由から、酸化アルミニウムの蒸着薄膜層を反応性蒸着法で形成させる方法が、原材料の安さと透明性の点から注目されるている。更に、この蒸着薄膜層の上にポリビニルアルコールなどのコーティングを行うことで、水蒸気バリア性が1g/m².24h程度の高水蒸気バリアフイルムが得られる。

[0008]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、前記酸化アルミニウムの蒸着薄膜層を反応性蒸着法で形成させる場合、装置内でのアルミニウム蒸気と酸素ガスの反応で形成される蒸着薄膜層は、反応させる時の酸素比率が多すぎると透明性が低下するということで組成制御が非常に難しい。アルミニウム蒸気に酸素ガスを混合し反応させる際、従来法では図3に示す如く真空蒸着装置10の直空チャンバー11内の冷却ドラム15の中央の下端

3

表面から酸素ガス供給口17までの長さ、つまりdの間隔が150mmを超える位置より酸素ガスをアルミニウム蒸気雰囲気中に供給し、アルミニウム蒸気と酸素ガスを反応させて、酸化アルミニウムからなる蒸着薄膜層を基材フイルム1上に形成させる方法で生産されていた。

【0009】前述の如き位置から酸素ガスを供給する反応性蒸着法では、ピンポイントの化学組成制御が必要となり、アルミニウム蒸気量の変化などによる組成変化に十分対応できず理想的な酸化アルミニウム組成を得ることが困難で、ガスバリア性低下の原因となっていた。

【0010】さらに、従来法では蒸着薄膜層表面の酸化アルミニウムが酸素元素過多になるために、他の成分との密着性に乏しい膜表面が形成され、その蒸着薄膜層の上にさらに積層するガスバリア性被膜層の密着が不十分になり、ガスバリア性低下の原因となっていた。これらの理由により酸化アルミニウムを用いたガスバリア性フィルムでは、水蒸気バリア性が0.5g/m².24h以下の高ガスバリア性は発現されていなかった。

【0011】本発明の課題は、基材フイルムの表面に蒸 着薄膜層を形成させる時に、フイルム表面から蒸着薄膜 20 の膜厚の外側に向けて傾斜型の金属酸化物組成の蒸着薄 膜層を、容易に、かつ、安定して形成させることによ り、高いガスバリア性を有するフイルムを提供するもの である。

[0012]

【課題を解決するための手段】本発明の請求項1に係る 発明は、高分子材料からなる基材フイルムの少なくとも 一方の面に、酸化アルミニウムの蒸着薄膜層、ガスバリ ア性被膜層を順次積層した積層体において、該酸化アル ミニウムの蒸着薄膜が金属蒸気と酸化性ガスとの反応性 30 蒸着法で形成されたものからなることを特徴とする高ガ スバリア性フイルムである。

【0013】次に、請求項2に係る発明は、上記請求項1に係る発明において、前記金属蒸気がアルミニウム蒸気であり、かつ、酸化性ガスが酸素ガスであることを特徴とする高ガスバリア性フイルムである。

【0014】次に、請求項3に係る発明は、上記請求項1又は請求項2に係る発明において、前記蒸着薄膜層の厚さが50~3000Åの範囲内であることを特徴とする高ガスバリア性フイルムである。

【0015】次に、請求項4に係る発明は、上記請求項1乃至請求項3のいずれか1項に係る発明において、前記ガスバリア性被膜層が、水溶性高分子と、(a)1種以上の金属アルコキシド及びその加水分解物又は(b)塩化錫の少なくとも一方を含むものからなることを特徴とする高ガスバリア性フイルムである。

【0016】次に、請求項5に係る発明は、上記請求項4に係る発明において、前記水溶性高分子がポリビニルアルコールであることを特徴とする高ガスバリア性フイルムである。

4

【0017】次に、請求項6に係る発明は、上記請求項4又は請求項5に係る発明において、前記金属アルコキシドがテトラエトキシシランまたはトリイソプロポキシアルミニウムあるいはそれらの混合物であることを特徴とする高ガスバリア性フイルムである。

【0018】次に、請求項7に係る発明は、上記請求項1乃至請求項6のいずれか1項記載の高ガスバリア性フイルムの酸化アルミニウムの蒸着薄膜層を金属蒸気と酸化性ガスの反応性蒸着法で形成させる時に、前記酸化性10 ガスを真空蒸着装置内の冷却ドラムの基材巻き出し側の表面より10mm以上150mm以下の位置の供給口から導入することを特徴とする高ガスバリア性フイルムの製造方法である。

[0019]

【作用】本発明によれば、基材フイルムの表面に近い側に酸素元素の比率が大きい酸化アルミニウムを形成させ、膜厚の外側方向に向けて順次アルミニウム元素の比率が大きい傾斜組成の酸化アルミニウムの蒸着薄膜層を形成させているので、より安定したガスバリア性が得られると共に、得られた蒸着薄膜層の外側表面がアルミニウム元素の比率が大きい金属酸化物になっているため、その上に積層されるガスバリア性被膜層の密着性が向上し、さらに高いガスバリア性が達成される。

[0020]

【発明の実施の形態】本発明の高ガスバリア性フイルム を実施の形態に沿って以下に詳細に説明する。

【0021】図1は本発明の一実施の形態を示す高ガス バリア性フイルムの側断面図であり、フイルムの厚み方 向に順に、基材フイルム1、酸化アルミニウムの蒸着薄 膜層2、ガスバリア性被膜層3が形成されている。な お、基材フイルム1に蒸着薄膜層2を積層したフイルム を蒸着フイルム4としている。

【0022】前記基材フイルム1は透明性を有する高分子材料であり、とくに無色透明であればよく、通常、包装材料として用いられるものが好ましい。例えば、ポリエチレンテレフタレート(PET)、ポリプロピレン(PP)、ナイロン(Ny)樹脂などの機械的強度、寸法安定性を有するものが好ましく、これらをフイルム状に加工、さらには二軸方向に延伸したものが用いられ

る。さらに表面平滑性が優れ、かつ添加剤の量が少ないフイルムが好ましい。また、この基材フイルム1の表面に蒸着薄膜層の密着性を良くするために、前処理としてコロナ処理、低温プラズマ処理、イオンボンバード処理を施しておいてもよく、さらに薬品処理、溶剤処理などを施してもよい。

【0023】基材フイルム1の厚さは特に制限を受ける ものではないが、包装材料としての適性、他のフイルム を積層あるいは蒸着薄膜層を形成する場合の加工性等を 考慮すると、5~100μmの範囲が好ましい。

50 【0024】また、量産性を考慮すれば、連続的に蒸着

薄膜層を形成できるように長尺状フイルムとすることが 望ましい。

【0025】前記蒸着薄膜層2は、アルミニウム金属を 蒸発原材料にして、酸素ガス、炭酸ガスと不活性ガスな どとの混合ガスの存在下で薄膜形成を行う、いわゆる反 応性蒸着が生産性の点から望ましい。その他に、反応性 スパッタリング、反応性イオンプレーティングにより連 続的に金属酸化物の蒸着薄膜層を形成することも出来 る。

【0026】前記蒸着薄膜層2の厚さは、50~300 10 OAの範囲内であることが望ましく、その値は適宜選択 される。ただし、膜厚が50Å以下であると基材フイル ム1の全面に均一な薄膜が形成されないことがあり、ガ スバリア材としての機能を十分に果たすことができない 場合がある。また、膜厚が3000Åを超えた場合は蒸 着薄膜にフレキシビリティを保持させることができず、 成膜後に折り曲げ、引っ張りなどの外的要因により、蒸 着薄膜に亀裂を生じる恐れがあるため良くない。

【0027】前記ガスバリア性被膜層3は、高いガスバ リア性を付与するために前記蒸着薄膜層2の上にさらに 20 積層されるものであり、その構成成分は水溶性高分子 と、(a)1種以上の金属アルコキシド及び加水分解物 または(b)塩化錫の少なくとも一方を含む水溶液ある いは水/アルコール混合溶液を主剤とするコーティング 剤を塗布して形成する。水溶性高分子と塩化錫を水系 (水あるいは水/アルコール混合)溶媒で溶解させた溶 液、あるいはこれに金属アルコキシドを直接または予め 加水分解させるなど処理を行ったものを混合した溶液を 金属酸化物の蒸着薄膜層2上にコーティング、加熱乾燥

【0028】前記ガスバリア性被膜層3に用いられる水 溶性高分子は、ポリビニルアルコール、ポリビニルピロ リドン、デンプン、メチルセルロース、カルボキシメチ ルセルロース、アルギン酸ナトリウム等が挙げられる。 特にポリビニルアルコール(以下、PVAとする)を用 いた場合にガスバリア性が最も優れる。ここでいうPV Aは、一般にポリ酢酸ビニルを鹸化して得られるもの で、酢酸基が数十%残存している、いわゆる部分鹸化P VAから酢酸基が数%しか残存していない完全鹸化PV Aまでを含み、特に限定されない。

し形成したものである。

【0029】また、前記塩化錫は塩化第一錫(SnC1 2)、塩化第二錫(SnC14)あるいはこれらの混合物 であっても良く、無水物でも水和物でも良い。

【0030】さらに、前記金属アルコキシドはテトラエ トキシシラン又はトリイソプロポキシアルミニウムある いはそれらの混合物が好ましい。

【0031】前記ガスバリア性被膜層3の塗布方法に は、通常用いられるディッピング法、ロールコーティン グ法、スクリーン印刷法、スプレー法などの従来公知の 手段を用いることができる。乾燥後の被膜厚さが0.0 50 2μmの二軸延伸ポリエステルフイルムを使用し、その

 1μ m以上あればよいが、厚さが 50μ mを超えると膜 にクラックが生じ易くなるため、 $0.01\sim50\mu$ mの 範囲が好ましい。

【0032】図2は本発明の高ガスバリア性フイルムの 蒸着薄膜層を反応性蒸着法で形成させる真空蒸着装置の 概略図である。基材フイルム1を真空蒸着装置10の巻 き出し部12に装着し、蒸着金属原材料20を、るつぼ 19に装填後、真空ポンプ18にて真空チャンバー11 内を真空度1.3×10⁻²~13×10⁻² Paの範囲 で真空にした後、基材フイルム1を巻き出し部12から ガイドロール14を経て巻き取り部13に搬送しなが ら、るつぼ19中の蒸着金属原材料20を電子線加熱方 式(図示せず)により加熱蒸発させ、同時に酸素ガス供 給口17から酸素ガスを供給する。酸素ガス供給口17 は、冷却ドラム15の基材フイルム1の巻き出し側の表 面からの空間、つまりdの間隔が10mm以上150m m以下であることが好ましい。10mm以下では、溶融 金属の輻射熱などによる、酸素供給口の形状変化による 冷却ドラム15への接触が懸念され、150mmを超え ると酸素の拡散が大きく、有効な傾斜型の金属酸化物薄 膜を作製出来ない。

[0033]

【実施例】本発明の高ガスバリア性フイルムを具体的な 実施例を挙げて説明するが、本発明がこれらの実施例に 限定されるものではない。

【0034】〈ガスバリア性被膜層の塗布液の調整〉テ トラエトキシシラン10.4gに0.1N塩酸を89. 6g加え、30分攪拌し加水分解させた固形分3重量% (SiO2換算)の溶液とポリビニルアルコール3重量 %水/イソプロピルアルコール溶液(水/イソプロピル アルコールは重量%比で90/10)を重量%比で60 /40に混合し、塗布液を調整した。

【0035】〈実施例1〉基材フイルム1として厚さ1 2 μmの二軸延伸ポリエステルフイルムを使用し、その 基材フイルム1を図2の真空蒸着装置10の巻き出し部 12に装着した後に、るつぼ19に蒸着金属原材料20 としてアルミニウムを装填し、電子線加熱方式で加熱蒸 発させ、酸素ガス供給口17から酸素ガスを供給し、基 材フイルム1を巻き出し部12から巻き取り部13方向 40 <u>へ120m/minのスピードで搬送することにより、</u> 厚さ200Åの酸化アルミニウムの蒸着薄膜層2を基材 フイルム1の上に形成した蒸着フイルム4を巻き取り部 13で巻き取った。さらに、前記蒸着フイルム4をグラ ビアコーター機に装着し、前記蒸着薄膜層2の上にグラ ビアコーティング法で前記ガスバリア性被膜層用塗布液 を塗布、乾燥し、厚さ0.5μmのガスバリア性被膜層 3を形成させ、本発明の高ガスバリア性フイルムを得 た。

【0036】〈比較例1〉基材フイルム1として厚さ1

7

基材フイルム1を図3の真空蒸着装置30の巻き出し部 12に装着した後に、るつぼ19に蒸着金属原材料20 としてアルミニウムを装填し、電子線加熱方式で加熱蒸 発させ、酸素ガス供給口17から酸素ガスを供給し、基 材フイルム1を巻き出し部12から巻き取り部13方向 へ120m/minのスピードで搬送することにより、 厚さ200Åの酸化アルミニウムの蒸着薄膜層2を基材 フイルム1の上に形成した蒸着フイルム4を巻き取り部 13で巻き取った。さらに、前記蒸着フイルム4をグラ ビアコーター機に装着し、前記蒸着薄膜層2の上にグラ 10 た。 ビアコーティング法で前記ガスバリア性被膜層用塗布液 を塗布、乾燥し、厚さ0.5μmのガスバリア性被膜層 3を形成させ、比較用のガスバリア性フイルムを得た。 【0037】〈評価〉実施例1及び比較例1のガスバリ ア性フイルムの光線透過率、酸素透過率及び水蒸気透過 率を以下に示す測定方法で測定し、透明性及びガスバリ ア性を評価した。その結果を表1に示す。

(1)光線透過率

基材フイルムに酸化アルミニウムの蒸着薄膜層及びガス*

*バリア性被膜層を順次積層した状態で、波長400nm での光線透過率を分光光度計(島津製作所社製、UV-3100)を用いて測定した。

8

(2)酸素透過率

基材フイルムに酸化アルミニウムの蒸着薄膜層を形成させた状態及び前記蒸着薄膜層面の上にガスバリア性被膜層を積層させた状態で、各々の酸素透過率をモダンコントロール社製(MOCON OXTRAN、10/50A)を用いて25℃、100%RH雰囲気下で測定し

(3)水蒸気透過率

基材フイルムに酸化アルミニウムの蒸着薄膜層を形成させた状態及び前記蒸着薄膜層面の上にガスバリア性被膜層を積層させた状態で、各々の水蒸気透過率をモダンコントロール社製(MOCON PERMATRAN、W 6)を用いて、40 $^{\circ}$ 、90 $^{\circ}$ RH雰囲気下で測定した。

[0038]

【表1】

	光線透過率	酸素透過率		水蒸気透過率	
		酸化アルミニウム	ガスパリア性被膜蹠布後	酸化アルミニウム	ガスバリア性被膜塗布後
		蒸灌後		蒸着後	
実施例1	80.5	14.7	2. 9	0.8	0.4
比較例1	80, 4	16.7	2. 9	2.5	0.9

※光線透過率の単位 : 9

※鞍繋透過率の単位 : ml/m²・24h・MPa

※水蒸気透過率の単位 : g/m²・24 h

【0039】表1の結果から、実施例1は透明性、酸素 ガスバリア性、水蒸気バリア性共に良好であるが、比較 例1は透明性、酸素ガスバリア性は良好であるが、水蒸 気バリア性が悪い。

[0040]

【発明の効果】本発明の高ガスバリア性フイルムは、基材フイルムに酸化アルミニウムの蒸着薄膜層を形成させる際に、フイルムの表面に近い側に酸素元素の比率が大きい酸化アルミニウムの薄膜を形成させ、膜厚の外側に向けてアルミニウム元素の比率が大きい酸化アルミニウムからなる傾斜型組成の蒸着薄膜層を反応性蒸着法で形成させているので、酸化アルミニウムの蒸着薄膜層のみを形成させた状態でも良好なガスバリア性を有しており、さらにその蒸着薄膜層の上にガスバリア性を関を積層することにより、より一層高いガスバリア性を発現させることができ、生産性が良く、透明で、かつ、高いガスバリア性フイルムを得ることができた。この高ガスバリア性フイルムにシーラントフイルム等を積層することにより、広い用途でのガスバリア性包装材料として利用出来る。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の高ガスバリア性フイルムの側断面図で※

※ある。

【図2】本発明の高ガスバリア性フイルムの蒸着薄膜層を形成する真空蒸着装置の概略説明図である。

60 【図3】従来のガスバリア性フイルムの蒸着薄膜層を形成する真空蒸着装置の概略説明図である。

【符号の説明】

1…基材フイルム

2…蒸着薄膜層

3…ガスバリア性被膜層

4…蒸着フイルム

10,30…真空蒸着装置

11…真空チャンバー

12…巻き出し部

40 13…巻き取り部

14…ガイドロール

15…冷却ドラム

16…酸素供給部

17…酸素ガス供給口

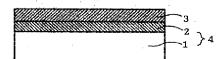
18…真空ポンプ

19…るつぼ

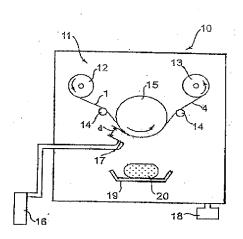
20…蒸着金属原材料

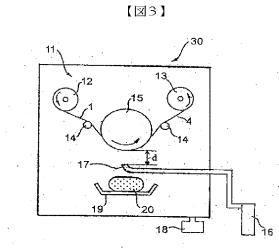
d…冷却ドラム表面と酸素ガス供給口の長さ

【図1】



[図2]





フロントページの続き

Fターム(参考) 4F100 AA05C AA19B AH02C AH06C

AHO8C AKO1A AKO1C AK21C AK42 AROOC ATOOA BA10A BA10C EH46 EH66B EH662 EJ38 GB15 GB23 JA20B JB09C JD02C JD03 JD04 YYOOB

4K029 AA11 BA44 BC00 BD00 CA02 DB03 EA01 GA03

DERWENT-ACC-NO: 2003-460805

DERWENT-WEEK: 200845

COPYRIGHT 2009 DERWENT INFORMATION LTD

TITLE: Gas-barrier film used for packing foodstuffs,

has vapor deposited thin-film of aluminum oxide formed by vapor deposition of metal vapor and oxidizing gas, and gas barrier film

layer

INVENTOR: SUZUKI H

PATENT-ASSIGNEE: TOPPAN PRINTING CO LTD[TOPP]

PRIORITY-DATA: 2001JP-152045 (May 22, 2001)

PATENT-FAMILY:

 PUB-NO
 PUB-DATE
 LANGUAGE

 JP 2002337262 A
 November 27, 2002 JA

 JP 4110748 B2
 July 2, 2008 JA

APPLICATION-DATA:

PUB-NO	APPL-DESCRIPTOR	APPL-NO	APPL- DATE
JP2002337262A	N/A	2001JP-	May 22,
		152045	2001
JP 4110748B2	Previous Publ	2001JP-	May 22,
JP 4110748B2	Previous Publ	2001JP- 152045	May 22, 2001

INT-CL-CURRENT:

TYPE	IPC DATE
CIPP	B32B9/00 20060101
CIPP	B32B9/00 20060101
CIPS	C23C14/08 20060101
CIPS	C23C14/08 20060101
CIPS	C23C14/20 20060101
CIPS	C23C14/20 20060101

ABSTRACTED-PUB-NO: JP 2002337262 A

BASIC-ABSTRACT:

NOVELTY - A gas barrier film has a laminate of vapor deposited thin film (2) of aluminum oxide and gas-barrier film layer (3) sequentially on at least one surface of a base material (1) consisting of polymeric material. The vapor deposited thin film is formed by vapor deposition of metal vapor and an oxidizing gas.

DESCRIPTION - An INDEPENDENT CLAIM is included for manufacture of gas-barrier film which involves forming vapordeposited thin film of aluminum oxide by vapor deposition of metal vapor and oxidizing gas, by introducing oxidizing gas from a supply port located at 10-150 mm distance from the surface of base material (after unwinding) which is mounted on a cooling drum of vacuum deposition apparatus. Subsequently, gas-barrier film is formed.

USE - For packaging foodstuffs, pharmaceutical and precision electronic component.

ADVANTAGE - The vapor deposited thin film layer with high rate of aluminum is formed. The film has high gas barrier property such as oxygen gas barrier property and transparency. The film is produced easily at high productivity.

DESCRIPTION OF DRAWING(S) - The figure shows the sectional side view of gas barrier film.

Base material (1)

Vapor deposited thin film (2)

Gas-barrier film layer (3)

EQUIVALENT-ABSTRACTS:

ORGANIC CHEMISTRY

Preferred Composition: The metal vapor is aluminum vapor and oxidizing gas is oxygen gas. The gas barrier film layer contains a water-soluble polymer, one or more kinds of metal alkoxide and is hydrolyzed product or tin chloride. The metal alkoxide is tetraethoxysilane and/or triisopropoxy aluminum. The vapor deposited thin film layer has thickness of 50-3000 Angstrom.

POLYMERS

Preferred Polymer: The water-soluble polymer is polyvinyl alcohol.

A base material of biaxially stretched polyester film was mounted on a roll of vacuum deposition apparatus. A crucible was loaded with aluminum which was then evaporated by heating and oxygen gas was supplied. The base material was supplied from roll and vapor deposited thin film of aluminum oxide of thickness of 200 Angstrom was formed on base material. A coating liquid containing tetraethoxysilane (10.4 g) in 0.1N hydrochloric acid (89.6 g) and polyvinyl alcohol in mixture of water and isopropyl alcohol, was applied on vapor deposited thin film and dried to form gas barrier film layer of thickness of 0.5 mum. The obtained gas barrier film had light transmittance of 80.5%. The oxygen transmission of film after forming vapor deposited thin film and gas barrier film layer was 14.7

ml/m2.24 hour.MPa and 2.9 ml/m2.24 hour.MPa respectively. The water-vapor transmission of the film after forming vapor deposited film and gas barrier film layer was 0.8 g/m2.24 hours and 0.9 g/m2.24 hours respectively.

CHOSEN-DRAWING: Dwg.1/3

TITLE-TERMS: GAS BARRIER FILM PACK FOOD

VAPOUR DEPOSIT THIN ALUMINIUM OXIDE FORMING METAL OXIDATION

LAYER

DERWENT-CLASS: A35 A92 P73

CPI-CODES: A11-B09E; A11-C04B1; A12-P01;

ENHANCED-POLYMER-INDEXING: Polymer Index [1.1] 018;

P1707 P1694 D01; S9999

S1285*R;

Polymer Index [1.2] 018; ND01; Q9999 Q8366*R; Q9999 Q7589*R; K9416; K9676*R; K9610 K9483; Q9999 Q7818*R; N9999 N7192 N7023; B9999 B4864

B4853 B4740; B9999 B4397 B4240; K9870 K9847 K9790; ND07; N9999 N7090 N7034 N7023: N9999 N7136 N7034

N7023;

SECONDARY-ACC-NO:

CPI Secondary Accession Numbers: 2003-122979

Non-CPI Secondary Accession Numbers: 2003-366544